(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-22396

(P2000-22396A)

(43)公開日 平成12年1月21日(2000.1.21)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
H05K 13/0	04	H05K 13/04	M 5E313
B 2 3 P 21/0	00 305	B 2 3 P 21/00	305A 5H269
G05B 19/4	104	G 0 5 B 19/19	P 5H303
19/1	19	G 0 5 D 3/12	W
// G05D 3/1	12	G05B 19/18	H
		審查請求 未請	求 請求項の数7 OL (全 10 頁)
(21)出願番号	特願平10-184373	(71)出顧人 00000)2185 一株式会社
(22)出顧日	平成10年6月30日(1998.6.30)	東京	郡品川区北品川6丁目7番35号
		(72)発明者 大野	勝彦
		東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ 一株式会社内	
		(74)代理人 10009	代理人 100094053
		弁理:	土 佐藤 隆久

最終頁に続く

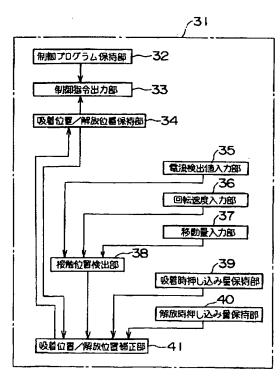
(54) 【発明の名称】 電子部品実装装置

(57)【要約】

【課題】ノズルによる電子部品の吸着ミスを低減でき、 配線基板への実装精度を向上させることができる電子部 品実装装置を比較的安価に提供する。

【解決手段】 電子部品13を吸着、解放するノズル12と、ノズル12を移動するH軸移動機構11と、ノズル12と電子部品13とが接触する位置に移動させる制御装置31と、電子部品13とノズル12との接触位置を検出する接触位置検出部38と、接触位置に基づいて電子部品の吸着位置を補正する吸着/解放位置補正部41とを有する。

BEST AVAILABLE COPY



10

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】電子部品を吸着、解放するノズルと、所定の位置に配置された電子部品または所定の位置に配置された配線基板の実装位置に対して前記ノズルを移動させて位置決めする移動位置決め手段とを有し、前記配線基板の実装位置に前記電子部品を実装する電子部品実装装置であって、

前記ノズルと前記電子部品とが接触する位置、または、 前記ノズルに吸着された電子部品と前記配線基板とが接 触する位置に当該ノズルを移動させる制御指令を前記移 動位置決め手段に出力する制御手段と、

前記電子部品と前記ノズルとの接触位置または前記ノズルに吸着された電子部品と前記配線基板との接触位置を 検出する接触位置検出手段と、

前記接触位置に基づいて、前記ノズルと前記電子部品と の相対位置、または、前記ノズルに吸着された前記電子 部品と前記配線基板との相対位置が所定の値となるよう に前記ノズルの前記電子部品の吸着位置または解放位置 を補正する吸着/解放位置補正手段とを有し、

前記制御手段は、補正されたノズルの吸着位置または解放位置に基づいて前記ノズルを駆動制御する電子部品実装装置。

【請求項2】前記制御手段は、前記ノズルと前記電子部品とが接触する所定の吸着位置、または、前記ノズルに吸着された電子部品と前記配線基板とが接触する所定の解放位置に前記ノズルを移動させ、前記吸着/解放位置補正手段によって補正された前記所定の吸着位置または解放位置に基づいて新たな電子部品または前記配線基板の新たな実装位置に対して前記ノズルを駆動制御する請求項1に記載の電子部品実装装置。

【請求項3】前記制御手段は、前記ノズルと前記電子部品とが所定の距離だけ離間する所定の吸着位置に前記ノズルを移動させ、この吸着位置からさらに前記ノズルを前記電子部品に接触するまで移動させ、前記吸着/解放位置補正手段によって補正された前記所定の吸着位置に基づいて新たな電子部品に対して前記ノズルを駆動制御する請求項1に記載の電子部品実装装置。

【請求項4】前記接触位置検出手段は、電子部品と前記 ノズルとの接触または前記ノズルに吸着された電子部品 と前記配線基板との接触によって前記ノズルの移動加速 度が変化する位置を検出して前記ノズルと前記電子部品 または前記配線基板との接触位置を検出する請求項1に 記載の電子部品実装装置。

【請求項5】前記接触位置検出手段は、電子部品と前記 ノズルとの接触または前記ノズルに吸着された電子部品 と配線基板との接触によって前記移動位置決め手段に印 加される外乱を検出して前記ノズルと前記電子部品また は前記配線基板との接触位置を検出する請求項1に記載 の電子部品実装装置。

【請求項6】前記移動位置決め手段は、可動部の移動量

を検出する位置検出器と移動速度を検出する速度検出器 と可動部を駆動する駆動電流を検出する電流検出器と備 えた駆動モータと、前記移動量、移動速度および駆動電 流に基づいて前記駆動モータの駆動制御を行なうサーボ 制御手段とを有し、

前記接触位置検出手段は、前記電流検出器からの電流検 出値および前記速度検出器からの速度検出値の微分値に 基づいて接触時点を検出し、この接触時点に対応する前 記位置検出器からの位置検出値から前記接触位置を検出 する請求項1に記載の電子部品実装装置。

【請求項7】前記吸着/解放位置補正手段は、前記接触位置と予め設定された前記ノズルの前記電子部品への押し込み量または前記ノズルに吸着された電子部品の前記配線基板への押し込み量とから前記吸着位置または前記解放位置を補正する請求項1に記載の電子部品実装装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子部品を配線基板に実装する電子部品実装装置に関する。

[0002]

【従来の技術】電子部品を配線基板に実装する電子部品 実装装置では、たとえば、パーツカセットに収容された 電子部品を吸着ノズルによって真空吸着し、この電子部 品を吸着した吸着ノズルを配線基板の所定の位置の上方 に移動し、電子部品を吸着した吸着ノズルを配線基板に 対して所定の位置まで近接させ、電子部品を解放するこ とによって配線基板に電子部品を実装する。上記の電子 部品実装装置では、電子部品の配線基板への実装効率を 向上させるためには、電子部品を吸着ノズルによって確 実にかつ適切な姿勢で吸着し、配線基板への実装位置に 適切に装着する必要がある。

[0003]

30

40

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、吸着ノ ズルによる電子部品の吸着においては、吸着ノズルは電 子部品の形状等に応じて複数種類から適宜選択して使用 されるが、各吸着ノズル間には、組み立て精度、寸法精 度のばらつきが存在する。また、電子部品を供給する各 パーツカセットにも寸法精度のばらつきが存在する。吸 着ノズルによって電子部品を吸着する際に、たとえば、 図9に示すように、吸着ノズル55の長さ寸法Aとパー ツカセット51の高さ寸法Bが適正な寸法であれば、エ ンボステープ52のエンボス部に収容された電子部品5 3は確実にかつ適切な姿勢で吸着される。吸着ノズル5 5の長さ寸法Aおよびパーツカセット51の高さ寸法B の少なくとも一方が適正な寸法よりも短い場合には、図 9 (b) に示すように、電子部品53と吸着ノズル55 の先端の間には隙間が生じ、この状態で電子部品53を 吸着すると、確実な吸着保持ができなかったり、図に示 すように吸着ノズル55に対して電子部品53の姿勢が

50

20

30

3

傾いたりする不具合が発生しやすくなる。吸着ノズル55の長さ寸法Aおよびパーツカセット51の高さ寸法Bの少なくとも一方が適正な寸法よりも長い場合には、図9(c)に示すように、吸着ノズル55がエンボステープ52のエンボス部内まで突出して電子部品53を出して電子部品53を明着保持できないことがエンボステープ52に食いついてしまい、吸着ノズル55によって電子部品53を吸着保持できないことが、1mの以下の所定の押し込み量でパーツカセット51に向けて明し込んだ状態で吸着する必要があるが、上記のはよりで吸着ノズル55とパーツカセット51に向けて吸着ノズル55とパーツカセット51に向けるに吸着ノズル55とパーツカセット51との相対位とがはらつくと押し込み量がばらつき、吸着ミスが発生しやすくなる。

【0004】吸着ノズルによって吸着保持された電子部品の配線基板の実装位置への実装においては、上記した吸着ノズルの組み立て精度、寸法精度のばらつきとともに、配線基板のそり等の変形による配線基板の形状誤差が存在する。吸着ノズルの組み立て精度、寸法精度設定が存在すると、吸着ノズルに電子が存在すると、吸着ノズルにでであると配線基板の実装部との相対位置が近すぎると配線基板がたわみない。この相対位置が近すぎると配線基板がたわみないで、この相対位置が近すぎると配線基板がたわみないで、この相対位置が近すぎると配線基板がたわみないで、この相対位置が近すさると配線基板の実装部とが発生しやすくなる。電子部品を吸着ノズルから解放すると、配線基板の実装部に設けられた接着剤やクリームハンダなどに電子部品が適切に付着せず、実装ミスが発生しやすくなる。

【0005】一方、上記の吸着ノズルやパーツカセットの寸法誤差、配線基板の形状誤差を個々に管理することは可能であるが、この管理作業は煩雑となり、電子部品の実装作業の効率の低下を招くという不利益があり、寸法等の測定装置を電子部品実装装置に備えると電子部品実装装置が高コストとなるといった不利益がある。

【0006】本発明は、上述の問題に鑑みてなされたものであって、ノズルによる電子部品の吸着ミスを低減でき、配線基板への実装精度を向上させることができる電子部品実装装置を比較的安価に提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、電子部品を吸着、解放するノズルと、所定の位置に配置された電子部品または所定の位置に配置された配線基板の実装位置に対して前記ノズルを移動させ位置決めする移動位置決め手段とを有し、前記配線基板の実装位置に前記電子部品を実装する電子部品実装装置であって、前記ノズルと前記電子部品とが接触する位置、または、前記ノズルに吸着された電子部品と前記配線基板とが接触する位置に当該ノズルを移動させる制御指令を前記移動位置決め手段50

に出力する制御手段と、前記電子部品と前記ノズルとの 接触位置または前記ノズルに吸着された電子部品と前記 配線基板との接触位置を検出する接触位置検出手段と、 前記接触位置に基づいて、前記ノズルと前記電子部品と の相対位置、または、前記ノズルに吸着された前記電子 部品と前記配線基板との相対位置が所定の値となるよう に前記ノズルの前記電子部品の吸着位置または解放位置 を補正する吸着/解放位置補正手段とを有し、前記制御 手段は、補正されたノズルの吸着位置または解放位置に 基づいて前記ノズルを駆動制御する。

【0008】本発明では、接触位置検出手段によって、 ノズルと電子部品との接触位置またはノズルに吸着保持 された電子部品と配線基板との接触位置を検出すること によりノズルと電子部品または配線基板との正確な相対 位置が検出される。この相対位置に基づいて吸着/解放 位置補正手段によって吸着位置または解放位置が補正さ れることにより、ノズルと電子部品またはノズルに吸着 された電子部品と配線基板との位置が常に一定となり、 正確な吸着、解放が行われる。

【0009】前記制御手段は、前記ノズルと前記電子部品とが接触する所定の吸着位置、または、前記ノズルに吸着された電子部品と前記配線基板とが接触する所定の解放位置に前記ノズルを移動させ、前記吸着/解放位置補正手段によって補正された前記所定の吸着位置または解放位置に基づいて新たな電子部品または前記配線基板の新たな実装位置に対して前記ノズルを駆動制御する。

【0010】前記制御手段は、前記ノズルと前記電子部品とが所定の距離だけ離間する所定の吸着位置に前記ノズルを移動させ、この吸着位置からさらに前記ノズルを前記電子部品に接触するまで移動させ、前記吸着/解放位置補正手段によって補正された前記所定の吸着位置に基づいて新たな電子部品に対して前記ノズルを駆動制御する。

【0011】前記接触位置検出手段は、電子部品と前記 ノズルとの接触または前記ノズルに吸着された電子部品 と前記配線基板との接触によって前記ノズルの移動加速 度が変化する位置を検出して前記ノズルと前記電子部品 または前記配線基板との接触位置を検出する。

【0012】前記接触位置検出手段は、電子部品と前記 ノズルとの接触または前記ノズルに吸着された電子部品 と配線基板との接触によって前記移動位置決め手段に入 力される外乱を検出して前記ノズルと前記電子部品また は前記配線基板との接触位置を検出する。

【0013】前記移動位置決め手段は、可動部の移動量 を検出する位置検出器と移動速度を検出する速度検出器 と可動部を駆動する駆動電流を検出する電流検出器と備 えた駆動モータと、前記移動量、移動速度および駆動電 流に基づいて前記駆動モータの駆動制御を行なうサーボ 制御手段とを有し、前記接触位置検出手段は、前記電流 検出器からの電流検出値および前記速度検出器からの速 度検出値の微分値に基づいて接触時点を検出し、この接触時点に対応する前記位置検出器からの位置検出値から前記接触位置を検出する。

【0014】前記吸着/解放位置補正手段は、前記接触位置と予め設定された前記ノズルの前記電子部品への押し込み量または前記ノズルに吸着された電子部品の前記配線基板への押し込み量とから前記吸着位置または前記解放位置を補正する。

[0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図1は、本発明の一実施形態に係る電子部品実装装置の全体構成を示す図である。図1に示す電子部品実装装置1において、Y軸方向に沿ってY1軸レール2およびY2軸レール3が平行に設けられている。Y1軸レール2およびY2軸レール3には、X軸方向に沿ってX軸レール4には、へッド部5が図示しない駆動装置によってX軸レール4に沿って移動可能に設けられている。X軸レール4に沿って移動可能に設けられている。へッド部5は、Y1軸レール2およびY2軸レール3とX軸レール4の各軸方向に沿って駆動されることより、所定の位置に配置された電子部品カセット16または配線基板15の上方の任意の位置に移動可能となっている。

【0016】図2は、ヘッド部5の構成を示す拡大図で ある。図2に示すヘッド部5は、ノズル12を2軸方向 に沿うH軸方向に昇降する、すなわちノズル12を電子 部品カセット16または配線基板15に対して近接、離 間させる方向に移動可能なH軸移動機構11を有してい る。図3は、H軸移動機構11の一構成例を示す図であ る。H軸移動機構11は、ノズル12はガイド16によ ってH軸方向に案内されてているとともに、ラック19 が固定されている。サーボモータ17の回転軸にはラッ ク19に噛合するピニオン18が固定されており、ラッ ク19およびピニオン18によってサーボモータ17の 回転駆動力を直動力に変換してノズル12に伝達する。 サーボモータ17には、サーボモータ17の回転位置制 御および回転速度制御を行なうサーボユニット21が接 続されており、サーボユニット21は、電子部品実装装 置1を総合的に制御する制御装置31に接続されてい る。なお、本実施形態では、サーボモータ17の回転駆 動力をラック19およびピニオン18によって直動力に 変換してノズル12をH軸方向に駆動する構成とした が、たとえば、リニアモータを用いてノズル12を直接 直動させる構成とすることも可能である。

【0017】図4は、サーボユニット21の一構成例を示す図である。サーボユニット21は、位置指令器22と、位置制御器23と、速度制御器24と、電流制御器25と、電力変換器26とを有する。サーボモータ17は、サーボモータ17の回転軸の回転速度を検出する回 50

転速度検出器27と、回転位置を検出する位置検出器2 8と、サーボモータ17の駆動電流を検出する電流セン サ29とを有する。位置検出器28には、サーボモータ . 17の回転量を検出するインクリメンタル方式のロータ リエンコーダやサーボモータ17の絶対的な回転位置を 検出できるアプソリュート方式のロータリエンコーダ や、レゾルバ等の各種の位置検出器を用いることができ る。回転速度検出器27には、たとえば、サーボモータ 17の回転速度に応じた電圧を発生するタコジェネレー タを用いることができ、また、位置検出器28の検出値 の単位時間毎の差分をとることによりサーボモータ17 の回転速度を検出することも可能である。電流センサ2 9には、電流検出用のコイルや、ホール素子等を用いる ことができる。位置検出器28、回転速度検出器27お よび電流センサ29の各検出値は、サーボユニット21 にフィードバックされているとともに、制御装置31に も入力されている。

【0018】位置指令器22は、制御装置31から出力 されたノズル12の移動すべき吸着位置または解放位置 をたとえば、パルス量等のサーボモータ17の回転すべ き回転量である位置指令 rp に変換して減算器 d e c 1 に出力する減算器 declでは、位置指令 rp と位置検 出器28からフィードバックされた検出値Pから位置偏 差Pe が算出され位置制御器23に出力される。位置制 御器23は、位置検出器28の検出したサーボモータ1 7の回転量Pと位置指令rp との位置偏差Pe に比例動 作を施して速度指令rvとし、減算器dec2に出力す る。減算器 de c 2 では、回転速度検出器 2 7 からフィ ードバックされた検出値 V と速度指令 r v との速度偏差 Ve が算出され、速度制御器24に出力される。速度制 御器24は、速度指令 r v と回転速度検出器27の検出 値Vとの速度偏差Ve に、比例動作、積分動作、微分動 作のいずれかまたはこれらの組合せを施して電流指令r i とし、この電流指令ri を減算器dec3に出力す る。減算器dec3では、電流指令riと電流センサ2 9からフィードバックされた検出値 I との電流偏差 I e が算出され、電流偏差 Ie が電流制御器 2 5 に出力され る。電流制御器25は、電流偏差Ie に比例動作、積分 動作等を施して電力変換器26に出力する。電力変換器 26は、電流制御器25からの指令に応じた電流を電源 からサーボモータ17に供給する。

【0019】図2において、ヘッド部5は、ノズル12をR軸方向に回転可能なR軸回転機構10と、ノズル12の下方に設けられた、ノズル12に対して所定の角度で傾斜する反射面7aを有するミラー7と、ミラー7の反射面7aに反射した像を所定の方向に反射する反射面8aを有するミラー8と、ミラー8の反射面8aで反射した像を撮像するカメラ部6とを有する。ミラー7は、M軸方向にミラー7を移動するM軸移動機構9に保持されているとともに、ノズル12が吸着した電子部品13

に光を照らすための照明装置14が設けられている。

【0020】上記構成のヘッド部5を有する電子部品実 装装置1の基本的動作は、まず、Y1軸レール2および Y2軸レール3とX軸レール4とに沿ってヘッド部5が 移動されることにより、電子部品13が整列して配置さ れている電子部品カセット16の上方にノズル12が移 動する。H軸移動機構11によってノズル12が電子部 品13に対して降下し、ノズル12が電子部品13を吸 着し、H軸移動機構11によって電子部品13が上方に 持ち上げられる。次いで、M軸移動機構 9 によってミラ -7と照明装置14とが、ノズル12によって吸着保持 された電子部品13の下方に移動する。ここで、照明装 置14が点灯し、ノズル12に吸着保持された電子部品 13に光を照らす。電子部品13の像は、ミラー7の反 射面7aで反射され、ミラー8の反射面8aに入射し、 反射面8 a で反射されてカメラ部6に入射し、電子部品 13の像がカメラ部6において撮像される。カメラ部6 において撮像された電子部品13の像は、所定の画像処 理装置によって画像処理され、電子部品13の中心位置 と電子部品13の向き(角度)が算出される。次いで、 M軸移動機構9によってミラー7および照明装置14が ノズル12とが干渉しない位置に移動され、ノズル12 に吸着保持された電子部品13は、R軸回転機構10に よって配線基板15の実装向きに合致した向きに回転さ れる。ノズル12は、配線基板15の上方に移動され、 H軸移動機構11によって配線基板15の実装位置に対 して降下され、ノズル12に吸着保持された電子部品1 3が配線基板15の実装位置に実装される。

【0021】ここまでは、電子部品実装装置1の基本構成および基本動作について説明したが、本実施形態に係る電子部品実装装置1はノズル12のH軸方向の駆動方法に特徴を有しており、以下にノズル12のH軸方向の駆動制御を行なう制御装置31の構成について説明する。図5は、制御装置31の一構成例を示す図である。制御装置31は、制御プログラム保持部32と、位置指令生成部33と、接触位置検出部34と、電流検出値入力部35と、回転速度入力部36と、回転位置入力部37と、吸着時ノズル移動量保持部39と、吸着/解放位置決定部40とを有しいる。

【0022】制御プログラム保持部32は、電子部品実装装置1を動作させるための予め用意されている制御プログラムを保持する。制御指令出力部33は、制御プログラム保持部32に保持された制御プログラムに基づいてノズル12を駆動する制御指令をサーボユニット21の位置指令発生器22に出力する。吸着位置/解放位置保持部34は、ノズル12の電子部品13を吸着する位置および電子部品13を解放する位置が予め設定保持されており、制御指令出力部33は、吸着位置/解放位置保持部34に保持されたデータを参照してノズル12を

駆動する制御指令を出力する。

【0023】電流検出値入力部35は、サーボモータ17に設けられた電流センサ29の検出値を所定のサンプリング時間毎にサンプリングして、所定のデータ形式に変換し、この変換された電流値を保持する。回転速度入力部36は、サーボモータ17に設けられた回転速度検出器27の検出値を所定のサンプリング時間毎にサンプリングして、所定のデータ形式に変換し保持する。回転検出器28の検出値を所定のサンプリング時間毎にサンプリングして、所定のデータ形式に変換し保持する。

【0024】接触位置検出部38は、電流検出値入力部35、回転速度入力部36および回転位置入力部37に入力されたデータに基づいて、ノズル12と電子部品13との接触位置またはノズル12に吸着保持された電子部品13と配線基板15とが接触したときのノズル12の位置を検出する。

【0025】サーボモータ17に設けられた回転速度検出器27の検出するサーボモータ17の回転速度を微分することにより得られるノズル12の加速度波形は、ノズル12が電子部品13または電子部品13を介して配線基板15に接触(衝突)することにより変化する。また、サーボモータ17の駆動電流波形は、サーボモータ17が出力するトルク波形に等しいことから、ノズル12が電子部品13または電子部品13を介して配線基板15に接触(衝突)すると、サーボモータ17には外乱トルクが入力され、サーボモータ17はこの外乱トルクを打ち消すためのトルクを発生する。このことから、接触位置検出部34は、ノズル12の加速度波形およびサーボモータ17の駆動電流波形から接触時点を検出することができる。

【0026】図6は、ノズル12に接触による外力が働かない場合の所定の位置までの移動の際のサーボモータ17の出力するトルク波形およびノズル12の加速度波形の一例を示す図である。図6(a)および(b)に示すように、ノズル12を下向きに移動させたとき、動き始めにはノズル12を下方向に加速するトルクが発生され、ある位置でノズル12を減速するトルクが発生され、ノズル12は所定の位置で停止する。この場合には、サーボモータ17の出力するトルク波形およびノズル12の加速度波形は、ノズル12に外力が働かないため滑らかに変化する。

【0027】一方、図7は、ノズル12に接触による外力が作用する場合のノズル12の移動の際のサーボモータ17の出力するトルク波形およびノズル12が電子部品13または配線基板15に接触(衝突)すると、この衝突による外乱トルクを打ち消すため、図7(a)に示すように、ノズル12を加速させる方向のトルクが発生する。

50 また、図7(b)に示すように、ノズル12には衝突に

10

よってノズル12を減速させる方向の加速度が急激に増 加する。

【0028】接触位置検出部38は、たとえば、予め図6に示した非衝突時のトルク波形および加速度波形のデータを保持しておき、これとサンプリングしたトルク波形および加速度波形のデータとをそれぞれ比較することにより、ノズル12と電子部品13または配線基板15との衝突時点を検出することができる。また、たとえば、サンプリングしたトルク波形および加速度波形のデータのサンプリング時間毎の差分値を算出することにより、衝突によるトルクおよび加速度の急峻な変化をトリガー状にして得ることができ、このトリガーの発生時点を衝突時点(接触時点)とすることも可能である。

【0029】本実施形態では、トルク波形および加速度 波形のデータの両方を用いて検出する構成としているが、トルク波形および加速度波形のデータのいずれか一方のみから衝突時点を検出することも可能である。しかしながら、トルク波形および加速度波形にノイズが含まれている場合に、一方のみからでは衝突時点を誤検出することもありうるが、図7に示したように、衝突時にトルク波形および加速度波形の変化は、向きが互いに逆となるため、両者の向きが逆となっていることを確認することにより、より確実な衝突時点の検出ができる。

【0030】接触位置検出部38では、トルク波形および加速度波形のデータから衝突時点を検出すると、この衝突時点に対応するノズル12の位置を移動量入力部37においてサンプリングされた移動量データに基づいて検出し、これがノズル12と電子部品13またはノズル12に吸着された電子部品13と配線基板15との接触位置となる。

【0031】吸着時押し込み量保持部39は、ノズル12と電子部品13との接触位置からノズル12の電子部品13を押し込むべき押し込み量を予め保持している。ノズル12の押し込み量は、電子部品13の種類、形状等に応じて設定されており、たとえば、1mm以下の押し込み量が設定される。

【0032】解放時押し込み量保持部40は、ノズル12に吸着保持された電子部品13と配線基板15との接触位置からノズル12が電子部品13を配線基板15に対して押し込むべき押し込み量を予め保持している。ノズル12の押し込み量は、電子部品13の種類、形状等に応じて設定されている。

【0033】吸着/解放位置補正部41は、吸着位置/解放位置保持部34に保持されたノズル12の吸着位置または解放位置を、ノズル12と電子部品13との相対位置、または、ノズル12に吸着された電子部品13と配線基板15との相対位置が所定となるように補正する。すなわち、接触位置検出部38において検出された接触位置に吸着時押し込み量保持部39または解放時押し込み量保持部40に保持された押し込み量を加えた位

置と、吸着位置/解放位置保持部34に保持されたノズル12の吸着位置または解放位置とが異なる場合には、接触位置検出部38で検出された接触位置に押し込み量を加えたものを新たな吸着位置または解放位置とする。これにより、吸着位置/解放位置保持部34に保持されたノズル12の吸着位置または解放位置は更新され、制御指令出力部33は、吸着位置/解放位置保持部34の更新されたデータを参照してノズル12を駆動する制御指令を出力する。

【0034】図8は、本発明の一実施形態に係る電子部品実装装置の実装動作の一例を説明するためのフローチャートであり、図8に基づいて本実施形態に係る電子部品実装装置の動作例について説明する。まず、ヘッド部5が電子部品カセット16に対して所定の位置に移動された状態で、制御装置31は吸着位置/解放位置保持部34に保持された吸着位置Hiに基づいてノズル12を駆動する制御指令がサーボユニット21に出力される(ステップS1)。

【0035】ノズル12が電子部品13に対して移動を開始すると同時に、制御装置31では、サーボモータ17の回転速度検出器27、位置検出器28および電流センサ29の検出値が、それぞれ移動量入力部37、回転速度入力部36および電流検出値入力部35によってサンプリングされる(ステップS2)。

【0036】ノズル12が吸着位置Hiに到達するまで各検出値のサンプリングを行い(ステップS3)、接触位置検出部38では、回転速度入力部36でサンプリングされた回転速度データを微分してノズル12の加速度データを算出し(ステップS4)、この加速度データ、トルク波形データおよび位置データからノズル12と電子部品13との接触位置Tiが検出される(ステップS5)。なお、ノズル12が電子部品13に衝突し、吸着位置Hiまで到達すると、ノズル12は電子部品13を吸着保持する。

【0037】次いで、吸着位置/解放位置補正部41では、接触位置Tiに吸着時押し込み量保持部39に保持された押し込み量Hpushを加えた値が、吸着位置Hiと異なる場合には、この値を新たな吸着位置Hi+1として、吸着位置/解放位置保持部34に保持された吸着位置を更新する(ステップS6)。制御装置31では、次の新たな電子部品13の吸着の際に、新たな吸着位置Hi+1に基づいてノズル12を駆動する(ステップS7)。

【0038】ここまで、ノズル12の吸着動作について 説明したが、ノズル12が吸着した電子部品13を配線 基板15に実装する動作についてもノズル12の吸着動 作と同様である。以上のように、本実施形態によれば、 ノズル12と電子部品13との接触位置または電子部品 13を介したノズル12と配線基板15との接触位置を 検出し、この位置から所定の押し込み量Hpushで移動し

40

(7)

た位置を新たな吸着位置Hi+1 とすることにより、ノズ ル12や電子部品カセット16に寸法誤差が存在しても ノズル12は電子部品13に対して一定の相対位置、一 定の押し込み量で吸着を行なうことができる。同様に、 電子部品13を吸着したノズル12と配線基板15との 相対位置も常に一定とすることができ、電子部品13を 常に一定の押し込み量で、配線基板15の実装位置に実 装することができる。この結果、電子部品13の吸着ミ スを低減でき、配線基板15への実装精度を高めること が可能になる。本実施形態では、吸着ノズル12の電子 部品13または配線基板15に対する相対位置を直接測 定するのではなく、所定の吸着位置または解放位置に移 動したときの電子部品13または配線基板15との接触 位置を検出して吸着ノズル12の電子部品13または配 線基板15に対する相対位置を検出するので、吸着ノズ ル12の吸着作業、解放作業を従来と同様の動作で行な うことができ、実装効率が低下することがない。また、 本実施形態に係る電子部品実装装置では、従来の電子部 品実装装置に対して新たな構成部品を追加する必要がな く、ソフトウェアの改変のみで実施できるため、比較的 安価に実施が可能である。

【0039】第2実施形態

上記の実施形態では、ノズル12を吸着位置Hiに移動させて吸着動作をしたときに、ノズル12と電子部品13との接触位置を検出して、この接触位置検出値から吸着位置Hiを補正して新たな吸着位置Hi+1を算出がある際に、ノズの新たな電子部品13を吸着する際に、ノズル12を発着は、これに限定されず、たとえば、ノズル12を吸着位置Hiに移動させる際に、ノズル12の移動速度を検出は、ノズル12と電子部品13との接触位置の検出はよび新たな吸着位置Hi+1をリアルタイムに算出してよび新たな吸着位置Hi+1をリアルタイムに質出してはなく新たな吸着位置Hi+1をリアルタイムに質出しているではなく新たな吸着位置Hi+1に移動させる構成とすることも可能である。このイズル12を吸着体とすることも可能であるが、ノズル12を吸着体とすることも可能であるが、ノズル12を電子部品13との相対位置をさらに正確に維持することが可能となる。

【0040】第3実施形態

第1の実施形態では、ノズル12によって電子部品13を吸着する際に、所定の押し込み量で電子部品13に対してノズル12を押し込んだ状態で吸着する場合について説明した。これは、ある程度重量の重い電子部品では、ノズル12を押し込んだ状態で吸着しないと十分な吸着力が得られないためである。しかしながら、たとえば、外形サイズが1mm×0.5mm×0.35mmのような微小な電子部品の場合には、電子部品カセット1

6に向けて電子部品13を押し込むと、電子部品13を 収容しているテープの下面に電子部品13が食い込んで しまい、吸着できなくなることがある。このため、微小 な電子部品の場合には、電子部品と接触するぎりぎりの 位置または0.1mm程度上方を吸着位置としてノズル 12を移動し吸着を行なっている。この場合には、吸着 時にノズル12は通常は電子部品13に衝突しないた め、上記第1実施形態の構成ではノズル12と電子部品 13との接触位置が検出できない。このため、制御装置 31は、ノズル12の交換時または電子部品カセット1 6の交換時に、ノズル12が低速度で電子部品13に接 触する位置まで移動させる。このときの接触位置を検出 し、この位置から所定の距離離間した位置をノズル12 の吸着位置とする補正をする。このような構成とすれ ば、ノズル12が電子部品13に当接しない吸着位置で 吸着する場合にも対応可能となる。

[0041]

【発明の効果】本発明によれば、ノズルの電子部品に対する吸着位置またはノズルの配線基板に対する電子部品の解放位置を常に一定とすることができ、ノズルによる電子部品の吸着ミスを低減でき、配線基板への実装精度を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明が適用される電子部品実装装置の一構成例を示す図である。

【図2】図1の電子部品実装装置のヘッド部の構成を示す拡大図である。

【図3】ノズル駆動部の一構成例を示す図である。

【図4】ノズル駆動部のサーボ制御部の構成例を示す図 である。

【図5】制御装置の一構成例を示す図である。

【図6】電子部品とノズルとの非接触時のトルクおよび 加速度波形を示す図である。

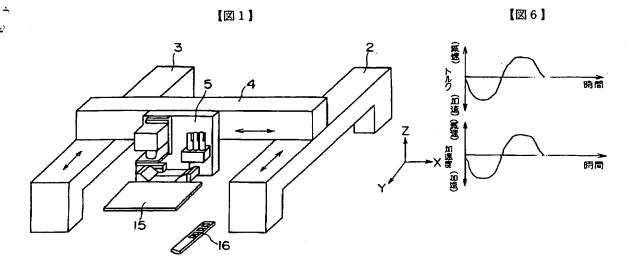
【図7】電子部品とノズルとの接触時のトルクおよび加速度波形を示す図である。

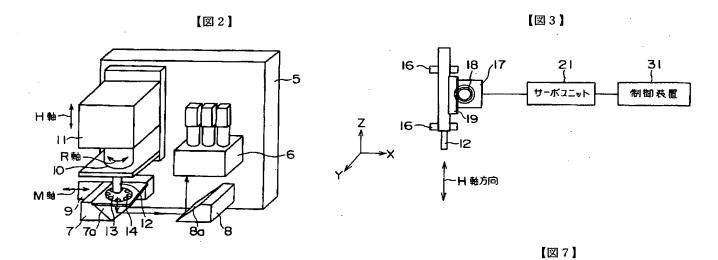
【図8】本発明の一実施形態に係る電子部品実装装置の 動作例を説明するためのフローチャートである。

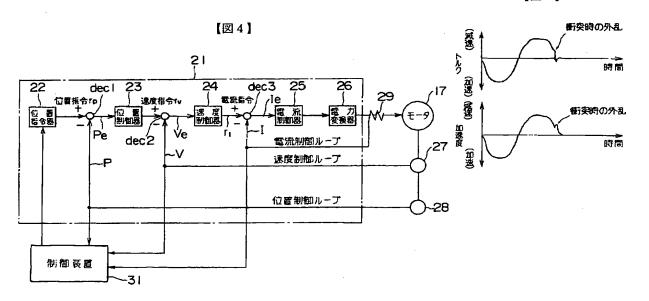
【図9】ノズルによって電子部品を吸着する際の様子を 示す図である。。

40 【符号の説明】

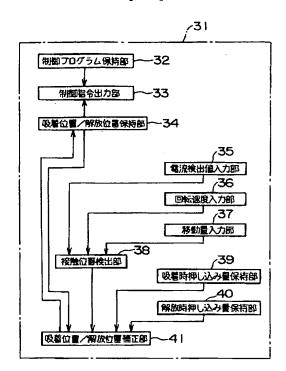
1…電子部品実装装置、12…ノズル、13…電子部品、15…配線基板、16…電子部品カセット、17…サーボモータ、21…サーボユニット、27…回転速度検出器、28…位置検出器、29…電流センサ、31…制御装置。





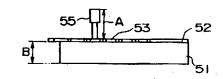


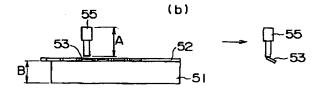
【図5】

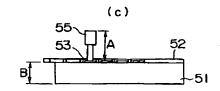


【図9】

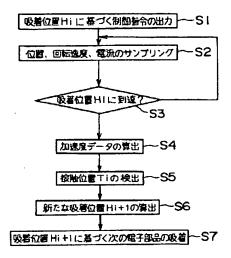








【図8】



フロントページの続き

8000 80MM

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.